



MEMS

Découvrez nos capacités

Le laboratoire MEMS du C2MI est doté de salles blanches de classe 10 (ISO 4). L'infrastructure est adaptée autant au micro-usinage de couche de surface qu'à celui du silicium. Le C2MI est doté de lignes de production pour la fabrication et l'encapsulation de MEMS sur des tranches de 200 mm.

Nos procédés

- Déposition de couches minces
- Lithographie
- Gravure humide
- Gravure sèche
- Décapage de résine
- Collage de tranches
- Décollage de tranches
- Polissage chimique/mécanique
- Placage
- Métrologie
- Traitement thermique
- Micro-usinage de surface





Le Centre

Le C2MI est le plus important centre de recherche et développement en microélectronique au Canada. Offrant des équipements à la fine-pointe de la technologie principalement dédiés à l'encapsulation avancée de puces électroniques et aux microsystèmes électromécaniques (MEMS), le Centre regroupe plus de 250 scientifiques en recherche et développement (R&D).

« La collaboration et la synergie de nos membres favorisent la commercialisation accélérée de prototypes avancés. »



Centre de Collaboration
MiQro Innovation

45 boulevard de l'Aéroport
Bromont, QC, Canada, J2L 1S8
450-534-8000
www.c2mi.ca

